

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第1部門第2区分

【発行日】平成23年8月18日(2011.8.18)

【公表番号】特表2010-540023(P2010-540023A)

【公表日】平成22年12月24日(2010.12.24)

【年通号数】公開・登録公報2010-051

【出願番号】特願2010-525858(P2010-525858)

【国際特許分類】

A 6 2 B 18/02 (2006.01)

【F I】

A 6 2 B 18/02 C

【手続補正書】

【提出日】平成23年6月29日(2011.6.29)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

(a) 長手方向次元に互いに近づきそして離れる動きをすることができる横断方向に延在する第一及び第二部材を含む支持構造と、

(b) フィルタ構造と、を含むマスク本体を含むフィルタリング顔面装着レスピレータであって、該フィルタ構造は、更に、

(i) フィルタ層と、

(ii) プリーツと、を含み、

該プリーツは、横断方向に延在する前記第一及び第二部材が互いに近づきそして離れる動きをするときに、それぞれ、前記フィルタ構造が収縮及び伸展することを可能にする、フィルタリング顔面装着レスピレータ。

【請求項2】

前記プリーツが、前記フィルタ構造の第一側面から第二側面にそれぞれ延在する第一及び第二境界線によって画定される、請求項1に記載のフィルタリング顔面装着レスピレータ。